

CONTENTS

Zhigalina O. M., Hmelenin D. N., Vorotilov K. A., Sigov A. S., Vasilyev V. A., Lebo I. G., Zvorykin V. D. <i>TEM Study of Barium-Strontium Titanate Thin Films after Laser Annealing</i>	2
Luchnikov P. A., Rogachev A. A., Luchnikov A. P. <i>Nanostructure and Morphology of Fluoropolymer Vacuum Film on Silicon</i>	6
Mustafaev A. G. <i>Silicon Plates with the Buried Layer Formation Technology</i>	11
Korostelev V. F. <i>Technology and Control of Shaping of Nanocrystalline Structure of Workpieces from Precision Alloys</i>	14
Agasiev A. A., Panakhov M. M., Mamedov M. Z., Mamedova V. J. <i>Temperature Dependence of Optical Absorption in Conducting Films SrTiO₃</i>	17
Kovalevsky A. A., Shevchenok A. A., Dolbik A. V., Strogova A. S. <i>The Influence Investigation of Thermotreatment Terms on Rate of Saturation Water of Micro- and Nanostructured Silicon Powders in Process of Pressing</i>	19
Bobrinetskii I. I., Nevolin V. K., Stroganov A. A., Ivanova O. M., Krutovertsev S. A. <i>The Effect of Environment Relative Humidity on the Transport Properties of Carbon Nanotube Based Structures</i>	23
Bychkov I. N. <i>Die Pads Planning and Wires Bonding Design for Packaging of Integrated Circuits</i>	26
Zajtsev N. A. <i>Physics-Technological Singularities of Devices Design on the Basis of Heterostructure-Silicon-Ferroelectric Film</i>	31
Rekhviashvili S. Sh. <i>Quantum Hall Effect: Interpretation and New Application</i>	34
Akopyan V. A., Rozhkov E. V., Soloviev A. N., Shevtsov S. N. <i>Method and Measure Complex for Modeling Processes of Controlled Suppression of Vibrations of Polymer-Composite Constructions by the PZT Actuators</i>	36
Chertoriiskiy A. A., Sergeev V. A. <i>The Control over Temperature Patterns and Thermophysical Characteristics of High-Power Transistors Using Dilatometric Method</i>	41
Glukhova O. E., Saliy I. N., Meschanov V. P. <i>Nano-Autoclave on the Basis of Carbon Nanopeapod</i>	47
Kazakov V. K., Nikiforov V. G., Safronov A. Ia., Chernov V. A. <i>Actuators for Optical Shutters and Methods of Dimensions of their Characteristics</i>	52
Spirin V. G. <i>Contact Resistance of a Thin-Film Resistor</i>	56
Solenov E. I., Popov L. K., Shevtsova A. G. <i>Optical Rectification of Affine Albuminous Complexes into Microliquid Devices</i>	60

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)

The journal bought since november 1999.

Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev

ISSN 1813-8586.

Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.

E-mail: nmst@zknet.ru; <http://www.microsystems.ru>

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: nmst@zknet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер Т. Н. Погорелова. Технический редактор О. А. Ефремова. Корректор Е. В. Комиссарова

Сдано в набор 18.08.2007. Подписано в печать 25.09.2007. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 11,85. Заказ 165. Цена договорная

Отпечатано в ООО "Подольская периодика". 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15